# InGaAs 近赤外線検出器の性能評価

都築 晃子 (名古屋大学大学院 理学研究科)

### Abstract

昨今の近赤外線天文装置には、高性能で大規模な二次元アレイ検出器が不可欠であるが、そのような検出器 は非常に高価なため、容易に入手できない。そこで、安価に入手可能な、中華立鼎光電社製 FPA640x512・ InGaAs 近赤外線検出器 (有効感度波長帯 0.9μm-1.7μm の半導体検出器)の、天文用途としての性能を評価す る。評価すべき性能として、暗電流、Full Well、量子効率、読み出しノイズがある。これらを適切に評価す るには、光電子の数 [e<sup>-</sup>] と、A/D 変換後に出力されるカウント値 [ADU] の換算係数 CF [e<sup>-</sup>/ADU] を正し く知る必要がある。本研究では、まずこの CF を実験で評価した。光子由来の電子の数が、その数の平方根で 揺らぐことを利用して、検出器の出力値と、その時のノイズの大きさから CF を求める。検出器に光を照射 し、出力値と分散を測定した。検出器出力が、ピクセル毎に大きくばらつくため、同じ状況で複数回測定を 行い、ピクセル毎に出力の平均値および分散を求めた。また、さらに出力値を安定させるために、検出素子 に印加するバイアス電圧を調整した。バイアス電圧を調整し、複数回測定を行った結果、CF は 36 e<sup>-</sup>/ADU となった。これは、仕様値の約3分の2である。また、検出素子に印加するバイアス電圧を約3倍にするこ とで、ピクセル毎の出力のばらつきは、出力値の数十%から数%程度に低減した。検出素子に印加するバイ アス電圧を変化させると、検出素子内部の、光を検知する空乏層の厚さが変化する。バイアス電圧が大きい 場合、空乏層の厚さが大きくなるため、出力値がピクセル毎でばらつかなくなると考えられる。今後は、今 回求めた CF の値を用いて、上述した評価項目について調査する。

## 1 はじめに

近年の近赤外線天文装置には、高性能かつ大規模 な二次元アレイ検出器が不可欠である。しかし、そ のような検出器は大変高価なため、容易に手に入れ ることはできない。そこで、安価に入手可能な中華 立鼎光電社製 FPA640x512・InGaAs 近赤外線検出器 の性能を評価する。安価で良質な検出器が存在すれ ば、大型望遠鏡のみならず中小望遠鏡においても、近 赤外線天体観測がより盛んに行われるようになると 期待できる。

FPA640x512・InGaAs 近赤外線検出器は、画素数が 640×512 個の二次元アレイ検出器である。各素子は、 半導体 InGaAs-p 型と InGaAs-n 型を張り合わせた構 造をしている。仕様上の有効感度波長は 0.9–1.7 μm であり、量子効率は 70%である。各素子には、信号を 読み出すための CTIA (Capacitive Trans-Impedance Amprifer) 回路が付随している。この読み出し回路の 概略を図1に示す。半導体素子に光子が入射すると、 素子内部で自由電子が発生し電流が流れ、CTIA 回 路のコンデンサに電子が蓄積される。CTIA 回路からは、電圧が出力される。さらに、その先の回路で 電圧はデジタル信号に変換され、そのデジタルカウ ントが最終的な出力値となる。

検出器の評価すべき性能として、暗電流や量子効 率、FullWell、読み出しノイズが挙げられる。これら の値を調査するにあたり、検出器に蓄積された電子の 数 [e<sup>-</sup>] が必要となる。しかし、測定結果として知るこ とができるのは A/D 変化後のカウント値 [ADU] で あるため、その換算係数 CF[e<sup>-</sup>/ADU] の値正しくを 知らなければならない。加えて、天体観測で検出器 を用いる際にもこの換算係数の正確な値が要求され る。以上から、本研究では、FPA640x512 InGaAs 検 出器の換算係数 CF [e<sup>-</sup>/ADU] の値を実験的に求め た。便宜上、本研究では、検出器のコンデンサに蓄 積した電子数  $e^-$  と、デジタル変換後の検出器信号 の単位 ADU の換算係数を、CF [e<sup>-</sup>/ADU] と呼称す る。なお、InGaAs 近赤外線検出器の仕様値から計算 すると、CF=59 e<sup>-</sup>/ADU と予測される。



図 1: CTIA 回路の概略図。検出素子に光が当たると 内部で自由電子が発生し、素子内部の電場により加速 され、電流として取り出される。取り出された電子は 回路のコンデンサに蓄積され、それによって生じる電 圧を読み出す。検出素子には VREF と VDECTOM の電圧値を調節することにより、任意のバイアス電 圧 V<sub>det</sub> をかける。

# 2 方法

#### 2.1 CF の導出

ー般的に CF は、ノイズを用いて測定される。検 出器信号に加わるノイズの合計 *n*<sub>total</sub> [e<sup>−</sup>] は、次の ように与えられる。

$$n_{\text{total}} = \sqrt{n_{\text{e}}^2 + n_{\text{read}}^2} \tag{1}$$

 $n_{\rm e} [{\rm e}^{-}]$ は検出器に貯まった電子数のゆらぎノイズ、  $n_{\rm read} [{\rm e}^{-}]$ は回路の読み出しノイズである。検出器に 貯まった電子の数を $S_{\rm e} [{\rm e}^{-}]$ とすると、 $n_{\rm e} = \sqrt{S_{\rm e}}$ と 表すことができるので、(1)式は次のように変形で きる。

$$n_{\text{total}}^2 = S_{\text{e}} + n_{\text{read}}^2 \tag{2}$$

ここで、 $\operatorname{CF}\left[\mathrm{e}^{-}/\mathrm{ADU}
ight]$ を用いると、 $n_{\mathrm{total}}$ は、

$$n_{\text{total}} [e^{-}] = CF [e^{-}/ADU] \times n_{\text{total},ADU} [ADU]$$

と書き表せる。ただし、*n*<sub>total,ADU</sub> は ADU 単位の合 計ノイズである。*S*<sub>e</sub>、*n*<sub>read</sub> についても同様に書き換 えると、 (2) 式は次のようになる。

 $(n_{\text{total},\text{ADU}})^2 = \frac{1}{\text{CF}} \times S_{\text{e},\text{ADU}} + (n_{\text{read},\text{ADU}})^2 \quad (3)$ 

(3) 式より、検出器に蓄積した電子数  $S_{e,ADU}$  と、そのときのノイズ  $n_{total,ADU}$ を測定すれば、CF を求めることができる。したがって、この2つの値を測定するための実験を行う。

#### 2.2 実験装置

検出器をアルミの箱の内部に設置し、上部の穴か ら光を照射した。実験装置の断面図を図2に示す。 検出器温度を一定に保つため、検出器に内臓されて いるペルチェ素子を用いて、温度を290Kに保った。



図 2: 実験装置の断面図。上部の穴から検出器に光を 照射し、測定を行った。



図 3: 実験装置の俯瞰図。

#### 2.3 解析方法

同じ環境下で取得した 10 枚の画像について、各ピ クセルの平均値と分散を算出した。各ピクセルの平 均値と分散を計算するので、それぞれ平均値の画像 と分散の画像を作ることができる。この平均値画像 および分散画像の、任意の領域での平均値をそれぞ れ  $S_{e,ADU}$ 、 $n_{total}^2$ として、(3)式を用いて fitting を 行い、CFを求めた。また、 $3\sigma$ の $\sigma$ クリップを 10 回 い、異常値を出力するピクセルを除去した。

## 3 結果

検出素子のバイアス電圧  $V_{det}$ =-0.07V に設定 し、10 枚の画像を取得した。それらの画像を用 いて領域 [x,y] = [400-500,250-350]について解析し、 式 (3) を利用して fitting を行った。fitting 結果を次 式に示す。

 $n_{\text{total,ADU}}^2 = (1.1 \pm 0.2) \times S_{\text{e,ADU}} + (-4000 \pm 1000)$ ここから CF を計算すると次式の値を得た。

 $\mathrm{CF} = 0.9 \pm 0.2 \, \mathrm{e^-/ADU}$ 

縦軸の切片が負であるため、読み出しノイズは求め ることができなかった。その原因として、出力値が ピクセル毎にばらつくことが考えられる。



図 4: バイアス電圧 V<sub>det</sub>=-0.07 V の時の fitting 結 果。横軸、縦軸は、それぞれ 100×100 ピクセルの平 均値 [ADU]、分散 [ADU<sup>2</sup>] である。黒丸がデータ点、 赤は fitting の結果を示す。

検出素子に印加するバイアス電圧  $V_{det}$  を変化させると、ピクセル毎のばらつきが変化することを利用し、 $V_{det} = -0.25V$ に設定し、CF 測定を行った。 $V_{det}$ と出力のばらつきの関係を表1に、フィッティング結果を図5に示す。

 $n_{\text{total,ADU}}^2 = (0.030 \pm 0.004) \times S_{e,ADU} + (50 \pm 40)$ これより次式の CF と読み出しノイズを算出した。

$$CF = 36 \pm 4 e^{-} / ADU$$
$$n_{read} = 300 \pm 70 e^{-}$$

この値は、仕様書からの予測値 59 e<sup>-</sup>/ADU の約 3 分 の 2 である。

表 1: 検出素子に印加するバイアス電圧 V<sub>det</sub> と出力画 面のばらつきの関係。それぞれの値は、各バイアス電 圧をかけた時の出力画像の、領域 [x,y]=[400-500,250-350] の平均値とその標準偏差である。

-		
$V_{\rm det}[{\rm V}]$	平均值 [ADU]	ばらつき [ADU]
-0.07	7600	6000
-0.13	9000	1000
-0.19	9300	500
-0.25	9500	400



図 5: バイアス電圧 V<sub>det</sub>=-0.25V の時の fitting 結 果。横軸、縦軸は、それぞれ 100×100 ピクセルの平 均値 [ADU]、分散 [ADU<sup>2</sup>] である。黒丸がデータ点、 赤は fitting の結果を示す。

### 4 考察

検出素子に印加する電圧を変化させると、ピクセ ル間の出力のばらつきが小さくなるという物理現象 について考察する。一般に、検出器の印加電圧が負 に大きくなると、空乏層の幅が広がる。光電流が発 生するのは空乏層に光が届くときなので、空乏層の 厚みが増すと感度が高くなり、出力値が大きくなる。 n型側、p型側の空乏層の厚み*w*<sub>n</sub>、*w*<sub>p</sub>は次式のよう に表せる。

$$w_n = \sqrt{\frac{2\varepsilon_{\rm r}\varepsilon_0 N_{\rm A} \left(\Delta\phi_0 - V_{\rm det}\right)}{e N_{\rm D} \left(N_{\rm A} + N_{\rm D}\right)}} \tag{4}$$

$$w_p = \sqrt{\frac{2\varepsilon_{\rm r}\varepsilon_0 N_{\rm D} \left(\Delta\phi_0 - V_{\rm det}\right)}{eN_{\rm A} \left(N_{\rm A} + N_{\rm D}\right)}} \tag{5}$$

 $\varepsilon_{\rm r}$ は半導体結晶の比誘電率、 $\varepsilon_0$ は真空の誘電率、 $N_{\rm A}$ 

、N<sub>D</sub>はそれぞれ、n型のアクセプター不純物濃度、p 型のドナー不純物濃度、 $\Delta \phi_0$ は印加電圧がかかって いない時の内蔵電位である。式(4)、(5)は、pn 接合 付近の電荷密度についてのポアソン方程式を、境界 条件を用いて解くことで導かれる。素子全体での空乏 層の厚みは $W = w_n + w_p$ となる。式(4)、(5)から、 空乏層の厚みは不純物濃度 N<sub>A</sub>、N<sub>D</sub> にも依存するこ とがわかる。この不純物濃度は、素子毎にばらつき がある可能性が考えられる。一方で、逆バイアスを強 く印加すると空乏層の厚みは広がる。FPA640x512・ InGaAs 検出器は、素子毎にそれぞれ印加電圧を加え るのではなく、全素子に一斉に加える仕組みになっ ている。そのため、全ての素子に同じ印加電圧が加 わっていると考えられる。これらを考慮すると、表 1の結果から、V<sub>det</sub> = -0.07 Vの時は、印加電圧が 弱いため、個々のピクセルの不純物濃度が空乏層の 厚みを支配しており、印加電圧を強めると、印加電 圧の影響が不純物濃度の影響の方が卓越すると考え られる。

また、光によって半導体内で生成された電子は、空 乏層に到達し加速されなければ、電流として検出さ れることはできない。検出器の構造上、光はp型半 導体側から照射される。つまり、電子は p 型半導体 を通り抜け、空乏層に到達しなければならない。空 乏層の幅が小さい時、電子が空乏層に到達するまで の距離が長いため、移動中にホールと再結合する確 率が高い。そのため、出力値は、素子や測定回によっ てばらつくことが予想される。一方、空乏層の幅が 大きいと、電子が空乏層まで移動する距離が短いた め、再結合の確率が低く、出力値は素子や測定回に よらず安定することが考えられる。加えて、電子の 再結合の観点から、空乏層の幅が小さい時は感度の 低下も予想され、出力値も小さくなると考えられる。 逆に空乏層の幅が大きい時は出力値が大きくなると 予想され、これは、表1の結果とも一致する。

## 5 まとめ

現在、中華立鼎光電社製 FPA640x512・近赤外線検 出器の性能評価を行っている。性能評価を行うにあ たり、光電子の数と A/D 変換後の出力値の換算係数



図 6: 検出素子に印されるの逆バイアスと空乏層の 幅 W の関係。逆バイアスが小さい時、W は不純物 濃度の大きさに強く影響され、出力値がばらつくと 予想される。一方、逆バイアスが大きい時は、W は 全素子に加わるバイアス電圧の影響が卓越し、出力 値のばらつきは小さくなると考えられる。

CF [e<sup>-</sup>/ADU] が重要となるため、本研究では、この CF の測定を行った。CF は任意の出力値と、その時 のノイズを測定することで求められるため、検出器 に光を照射し、出力の平均値と分散を測定した。出力 値のばらつきが大きかったが、検出素子に印加する バイアス電圧を約3倍にすることで、ばらつきを 60 分の1に抑えることができた。その結果として得ら れた CF は 36 e<sup>-</sup>/ADU であった。バイアス電圧を大 きくすることで出力値のばらつきが小さくなった理 由として、空乏層の厚さが大きくなったことが考えら える。今後は、測定した CF の値を用いて、InGaAs 近赤外線検出器の性能について調査を進める。

## 謝辞

基礎物理学研究所(研究会番号:YITP-W-15-04) 及び国立天文台からのご支援に感謝いたします。

### Reference

永山貴宏 2004,名古屋大学博士論文 竹内菜未 2015,名古屋大学修士論文 フック,&ホール 2002,『固体物理学入門上』丸善